

广东众元半导体科技有限公司

分子束裂解炉

ZY-Sb-200/2000

锑 (Sb) 源炉产品



众元半导体
TrueOne® Semiconductor

<http://www.TrueOneTech.com>

分子束裂解阀炉 (ZY-Sb-200/2000)

用于超高真空 (UHV) 下蒸发砷 (Sb) 材料

工作温度：200~750°C。

适用于 VEECO 等市场上大部分的分子束外延 (MBE) 系统。

该系列阀炉采用 PBN 套接阀门调节流量

阀门响应时间小于 5 秒 (全开到全关)

包含 2 个独立控制的加热区和 2 个高精度热电偶

顶端裂解区加热区的温度高于底部升华区加热区的温度。

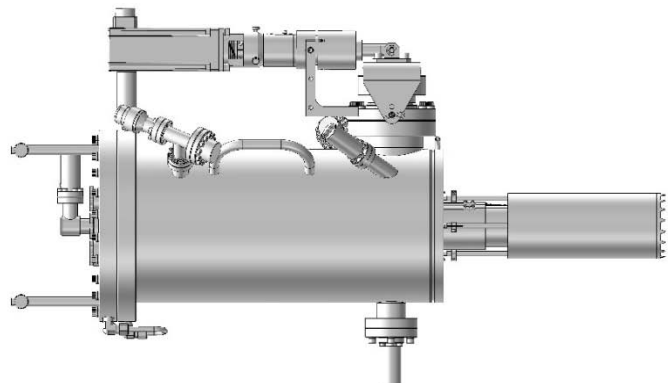
该产品基于多物理场耦合的分子流仿真优化设计

其热稳定性、温度精确控制以及操作控制等方面均达到较高的水平

满足精确控制外延层的厚度、组分、掺杂和周期性等要求。

性能与优点：

- ◆ 容量较大，支持长时间工作；
- ◆ 源消耗较低；
- ◆ 更高效率和更彻底的除气；
- ◆ 更宽广的工作温度范围
- ◆ 更精准的加热温度控制
- ◆ 更大的源流量调控范围比
- ◆ 更可靠的运行



技术参数:

源型号	200cc	2000cc	
最大填料重量	0.8Kg	9.2Kg	
坩埚直径	48mm	125mm	
坩埚填料高度	140mm	224mm	
真空内侧长度	218mm	290mm	
真空内侧直径	56mm	86.4mm	
填料口直径	25mm	32.5mm	
上部除气温度	1400℃	1400℃	
上部使用温度	600~1200℃	600~1200℃	
下部除气温度	850℃	850℃	
下部使用温度	200~750℃	200~750℃	
温度稳定性	≤±0.1℃	≤±0.1℃	
阀门响应时间	小于 5 秒（全开到全关）		
最小安装法兰	法兰CF100，可根据客户设备扩大		
开关比	≥1050		

详询：广东众元半导体科技有限公司

地址：广东佛山南海桂城街道平洲南港大街 5 号 1 楼

电话：0757-81813939 传真：0757-81813923

电邮：info@trueonetech.com